TEIDES! DOINT INDIVISE

1/1

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-001757

(43)Date of publication of application: 06.01.1999

(51)Int.Cl.

C23C 4/10 C23C 28/00

C23C 30/00

H016 13/00

(21)Application number: 10-090027

(71)Applicant: TOSHIBA CERAMICS CO LTD

(72)Inventor: INOUE TOSHIYA

(22)Date of filing:

02.04.1998

KAWAI KAZUHIDE

**UEMOTO HIDEO** 

(30)Priority

Priority number: 09 95871

Priority date: 14.04.1997

Priority country: JP

## (54) JIG FOR BURNING IN NONOXIDIZING ATMOSPHERE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a jig material for burning in nonoxidizing atmosphere capable of executing excellent burning of parts to be burnt without any reaction on the materials of the parts by arranging stabilized zirconia sprayed layer on the surface of molybdenum base material through a metallic coating layer and ceramic layer.

SOLUTION: As for the material for a jig for burning in nonoxidizing atmosohere at the time of burning electronic parts such as layer-built ceramic capacitor and the like, materials having zirconia sprayed layer on the surface of molybdenum base metal are used. In this case, between the molybdenum base material and zirconia sprayed layer, a ceramic layer with a thickness of 100-500 μm of at least one kind of alumina, spinel, titania, chromia and the like with an coefficient of thermal expansion coefficient between the two materials mentioned ahead is formed, and further on the surface of molybdenum base material, a metallic layer with a thickness of 10-50 µm comprising Cr, Cr alloy and the like is provided. For the zirconia sprayed layer, a stabilized zirconia sprayed layer stabilized with calcia, yttria and the like is used.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

11.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of

12.10.2004

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公閱番号

## 特開平11-1757

(43)公開日 平成11年(1999)1月6日

(51) int.CL*	識別配号	P I
C23C 4/10		C23C 4/10
28/00		28/00 B
30/00		30/00 C
H01G 13/00	351	H01G 13/00 351A
·	•	客空前求 未請求 請求項の数7 OL (全 6 B
(21)出國番号	<b>特度平10-90027</b>	(71)出版人 000221122
Anymers o	1144 110 0000.	東芝セラミックス株式会社
(22)出頭目	平成10年(1998) 4月2日	東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
		(72) 宛明者 井上 俊哉
(31)優先権主張番号	<b>特膜平9</b> -95871	神奈川県東野市曽屋30番地 東芝セラミ
(32) 任先日	平 9 (1997) 4 月14日	クス株式会社開発研究所内
(33) 優先権主張国	日本 (JP)	(72) 発明者 河合 和秀
		神奈川県東野市曽屋30番地 東芝セラミ
		クス株式会社開発研究所内
	•	(72) 発明者 上本 英雄
		神奈川県東野市曽屋30番地 東芝セラミ
		クス株式会社関発研究所内
		(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

## (54) [発明の名称] 非酸化性雰囲気焼成用給具

## (57)【要約】

【課題】 積層セラミックコンデンサのような被焼成部 品をその材料と反応を生じることなく良好に焼成でき、かつ薄肉化が可能で、さらに再利用が可能な非酸化性雰囲気焼成用治具を提供する。 【解決手段】 モリブデン基材の表面にジルコニア溶射

【解決手段】 モリブデン基材の表面にジルコニア溶射 層を形成してなることを特徴とする。

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 モリブデン基材の表面にジルコニア溶射 層を形成してなることを特徴とする非酸化性第囲気焼成 用治耳。

(請求項2) 前記モリブデン基材と前記溶射層の間には、モリブデンとジルコニアの中間の熱彫張率を有するセラミック溶射層が介在されることを特徴とする請求項1記載の非酸化性雰囲気焼成用治具。

【請求項3】 前記セラミックスは、アルミナ、スピネル、チタニア、クロミアから選ばれる少なくとも1つか 10 らなることを特徴とする請求項2記載の非酸化性雰囲気 焼成用治具。

【請求項4】 前記モリブデン基材は、前記ジルコニア 溶射層が形成される表面に金属層がコーティングされて いるととを特徴とする請求項1~3いずれか記載の非酸 化性雰囲気焼成用治具。

【請求項5】 前記金属圏の金属は、Cr、Cr-Mo 系合金、Cr-Fe系合金、Cr-Ni系合金、Cr-Ti系合金、Cr-Al系合金およびCr-Nb系合金 から選ばれることを特徴とする請求項4記載の非酸化性 20 常期気焼成用治具。

【請求項8】 前記ジルコニアは、カルシアおよびイットリアから選ばれる少なくとも1つで安定化されている安定化ジルコニアであることを特徴とする請求項1記載の非酸化性雰囲気焼成用治具。

【請求項7】 前配ジルコニアは、カルシアおよびイットリアから選ばれる少なくとも1つで安定化されている安定化ジルコニアと未安定化ジルコニアの混合物からなることを特徴とする請求項1記載の非酸化性雰囲気焼成用治具。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、積層セラミックコンデンサ等の電子部品を非酸化性雰囲気で焼成する際に用いるとう体、様板、セッタなどの治具に関する。

#### [0002]

【従来の技術】 領層セラミックコンデンサ等の電子部品の焼成には、前記コンデンサとの接触部分での反応が最も少ないジルコニア(ZrO。)質の熱処理用治具が用いられている。 実際の焼成には、アルミナ・シリカ系基 40体、ジルコニア系基体が使用されている。 このような焼成において、アルミナ・シリカ系基体を用いる場合には被焼成部品と基体との反応を防ぐためにジルコニアセッタを載置したり、ジルコニア粉末の焼成層やアルミナ、スピネル、ジルコニア等の溶射層で表面を被覆することが行われている。

(0003) ところで、積層セラミックコンデンサの高容量化により電極材料の占める割合が高くなり、内部電極のコスト低減を目的としてニッケル、銅等の卑金属を電極材料として使用したものが普及し始めている。この 50

ような積層セラミックコンデンサは今までの積層セラミックコンデンサの製法と異なり酸素分氏が10<sup>-11</sup>~10<sup>-1</sup>Paの強い選元性雰囲気で焼成される。この焼成に際し、治具の基材が10%以上の開気孔率を有するため、内部に水分が存在し易くなり、基材からの酸素の放出により低酸素分丘の制御に支障となる。したがって、より級密な治具が望まれている。

2

【0004】また、従来の治具の内厚は、4mm以上であるが、より薄肉化することにより生産コストの低減化を図ることが必要である。このため、高強度の治具が望まれている。

(0005) さらに、従来の焼成用治具はある期間使用 して寿命になる産業廃棄物として処理されていた。との ため、寿命になっても補格して再利用できる治具が望ま れている。

### [0008]

【発明が解決しようとする問題】本発明は、積層セラミックコンデンサのような被集成部品をその材料と反応を生じることなく良好に競成でき、かつ解内化が可能で、さらに再利用が可能な非酸化性雰囲気焼成用治具を提供しようとするものである。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明に係わる非酸化性 雰囲気焼成用治具は、モリブデン基材の表面にジルコニ ア溶射層を形成してなることを特徴とするものである。 【0008】

【発明の実施の整様】以下、本発明に係わる非酸化性雰囲気焼成用治具を詳細に説明する。この非酸化性雰囲気 焼成用治具は、こう体、板状、皿状等をなすモリブデン 多の 基材の表面にジルコニア溶射層を形成した構造を有す

【0009】前記ジルコニア溶射層は、前配モリブデン 基材を外界から保護する観点から、気孔率6%以下であることが好ましい。前配ジルコニア溶射層は、大気中での溶射により形成してもよいが、100~500torrの減圧雰囲気下で行う方が緻密な溶射層を形成することができる。溶射手段としては、例えばガスプラズマ溶射法、水ブラズマ溶射法を採用することができる。

【0010】前記ジルコニアは、カルシア(CaO) およびイットリア(Y。O。)から選ばれる少なくとも1つの安定化材で安定化された安定化ジルコニアであることが好ましい。

【0011】前記ジルコニアは、カルシア(CaO) およびイットリア(Y,O,)で安定化された安定化ジルコニアと未安定化ジルコニアの混合物からなることを許容する。前記安定化ジルコニアと未安定化ジルコニアとの混合割合は、安定化度により異なるが、安定化ジルコニア50~95重量%、未安定化ジルコニア5~50重量%にすることが好ましい。

) 【0012】前記モリブデン基材と前記ジルコニア溶射

30

層との間には、モリブデンとジルコニアの中間の熱彫張 率を有するセラミック溶射層を介在することを許容す る。前記セラミックスは、アルミナ、スピネル、チタニ ア、クロミアから通ばれる少なくとも1つを用いること ができる。

【0013】前記セラミック浴射層を前記基材表面に形 成するに先立って、前記基材表面を租面化することが密 着性を高める点で有効である。この粗面化手段として は、例えばエッチング等の化学的方法、アルミナ粉末ま たは炭化珪素粉末を用いたブラスト処理法を採用するこ とができる。治射時の雰囲気は、前述したように大気中 で行ってもよいが、100~500torrの減圧雰囲 気下で行う方が緻密なセラミック溶射層を形成すること ができる。治射手段としては、例えばガスブラズマ溶射 法、水プラズマ浴射法を採用することができるが、特に 級密なセラミック層を形成する観点からガスプラズマ法 が好ましい。

【0014】前記セラミック層は、100~500µm 厚さを有することが好ましい。前配モリブデン基材と前 記ジルコニア溶射層(またはセラミック溶射層)の間に 20 金属コーティング層を形成することを許容する。この金 属層の金属としては、例えばCr、CrーMo系合金、 Cr-Fe系合金、Cr-Ni系合金、Cr-Ti系合 金、Cr-Al系合金、Cr-Nb系合金等を挙げるこ とができ、特にCェが好適である。

【0015】前記金属のコーティング手段としては、例 えば前記金属をスプレーもしくは溶射により行うか、ま たはスプレーもしくは溶射の後にアルゴンまたは水素雰 囲気中、1300℃以上で焼成する方法が採用される。 【0018】前記金属コーティング層は、10~50 μ mの厚さを有することが好ましい。この理由は、前記金 属コーティング階の厚さを10μπ未満にすると、モリ ブデン基材を外界から遮断するバリア作用が十分に達成 されず、かつジルコニア溶射層(またはセラミック溶射 周) の密着性の向上が十分に達成されず、さらに耐衝撃 性の向上を図ることが困難になる。一方、前記金属コー ティング層の厚さが50μmを越えると熱歪みによる剝 館が生じる恐れがある。

【0017】以上説明した本発明に係わる非酸化性雰囲 気焼成用治具は、モリブデン基材の表面にジルコニア溶 射層を被覆した構造を有するため、積層セラミックコン デンサのような被焼成部品をその材料と反応を生じるこ となく良好に焼成でき、かつ薄肉化が可能で、さらに再 利用できる。

【0018】すなわち、前記基材の材料であるモリブデ ンは融点が高く、低熱膨張率、高熱伝導率、高強度であ るという特性を有し、薄肉で使用できることから、従来 のセラミック系電子部品の焼成治具として既に使用され ている。しかしながら、モリブデンは300℃の温度以 上の融索が存在する雰囲気で酸化され、800℃以上の 50 素と水素の混合ガスで焼成する際、前配金属コーティン

**寮紫雰囲気(例えば積層セラミックコンデンサの焼成時** に用いられる窒素と水素の混合ガス雰囲気)で窒化され て脆化される。とのため、前配基材表面を気孔率の低い ジルコニア溶射層とセラミック溶射層または金属コーテ ィング層とで覆うことによって、前配モリブデン基材の 特性を生かしつつ、酸素や窒素による脆化を防ぐことが できる。前記ジルコニア浴射層は、前記基材の外界から の遮断のみならず、前配治具に設置する積層セラミック コンデンサのような被焼成部品の材料との反応を防止し て前記被焼成部品を良好に焼成する作用を有する。

【0018】また、モリブデンは機械的強度がアルミナ ・シリカ系セラミックやジルコニアに比べて常温、高温 共に優れている。具体的には、治具として使用されるア ルミナ98%、シリカ2%のセラミックスの引張り強度 は常温で7~9MPa、1000℃で6~8MPaであ る。同様にジルコニア95%、カルシア5%の安定化ジ ルコニアの引張り強度は常温で8~14MPa、100 0℃で8~13MPaである。一方、モリブデンの引張 り強度は常温で440MPa、1000℃で245MP aである。このようにモリブデンは常温、高温共化価れ た機械的強度を有するため、内厚を0.5~1mmと釋 くしても十分な強度を有する治具を実現できる。その結 果、この非酸化性雰囲気用治具を用いることによって、 電子部品の生産コストを低減することが可能になる。

【0020】さらに、前記基材表面の溶射層が剥離して 使用に耐えられなくなった場合には、研削により溶射層 を除去し、新たな溶射器を形成することにより再使用で きる。しかも、多数回の治具の使用により基材が変形し. てもモリブデンは延性に富み、変形加工により容易に係 復できる。例えば、基材に反りが発生しても、加熱して ブレスすることにより再利用できる。また、浴射層の損 仏により基材のモリブデン表面が酸化されたり、窒化さ れた場合には基材表面の酸化層または窒化層を研削する ことにより再利用できる。

【0021】さらに、前記基材であるモリブデンとジル コニア(例えば安定化ジルコニア)は熱彫張係数の差が 大きいために、加熱・冷却の熱履歴を繰り返し受ける と、前記ジルコニア溶射層が剥離する恐れがある。との ようなことから前記モリブデン基材と前記ジルコニア裕 射層との間に、モリブデンとジルコニアの中間の熱彫器 串を有するアルミナのようなセラミック浴射層を介在す ることによって、前記熱度歴を受けるてもジルコニア溶 射層が剝離することなく、繰り返し使用することができ

【0022】さらに、前記ジルコニア溶射層が形成され る前記基材表面にクロムのような金属コーティング層を 形成することによって、前記モリブデンからなる基材を 外界からより効果的に保護することができる。その結 果、積層セラミックコンデンサのような非焼成部品を窒

**グ層がパリア層として機能して前記基材の窒化による脆** 化を防止することができる。前記金属コーティング層を ジルコニア溶射層(またはセラミックス溶射層)の下地 とすることによって、前記ジルコニア浴射層(またはセ ラミックス溶射層) を前記基材に対して強固に密着する ことができる.

【0023】さらに、前記金属コーティング層としてモ リブデンとジルコニアの中間の熱彫張率を有するものを **選択すれば、前記金属コーティング層を有する治具が熱** 屋族を受けてもジルコニア給射層が剥離することなく、 繰り返し使用することができる。

#### {0024]

【実施例】以下、本発明の好ましい実施例を説明する。 (実施例1-1~1-4および比較例1)幅100m m、長さ100mm、厚さ1mmのモリブデン基材の表 面にガスプラズマ法により厚さ約150μmの下記表1 に示すジルコニア層を溶射することにより5種の焼成用 治具を製造した。

[0025] 得られた実施例1-1~1-4および比較 例1の焼成用治具について、窒素雰囲気中、1400℃ 20 【表2】 に加熱した後、室温まで冷却する加熱冷却サイクルを複 数回行い、ジルコニア層が剝離する回数を調べた。その 結果を下記表1 に併配する。

#### [0026]

#### (土1)

	溶射ジルコニアの程 類・	到離兒生までの加熱 冷却回数 (回)	
実施例1-1	C=O安定化	7	
宴施例1-2	Y2O3安定化	6	
实施例1-3	安定化; 60+45 未安定化; 40+45	10	
実施例1-4	安定化;90mts 未安定化;10mts	8	
比较例1	未安定化	3	

\*: 実施例(-3, 1-4の安定化とは、CaOにより安定化された

グルコニアである。

【0027】前記表1から明らかなように基材上に未安 定化のジルコニア層を形成した比較例 1 の焼成用治具で は、3回の加熱冷却サイクルで前記ジルコニア層の剥離 が認められた。これに対し、基材上に安定化ジルコニア 層や安定化ジルコニアと未安定化ジルコニアの混合層を 形成した実施例1-1~1-4の焼成用治具では比較例 1 に比べて倍以上の加熱冷却サイクルで剥離が生じない ことがわかる.

【0028】(実施例2-1~2-4)実施例1と同様 10 のモリブデン基材の表面にガスプラズマ法により厚さ約 150μmの下配表2に示すセラミック層を溶射した 後、ガスプラズマ法により厚さ約150μmのカルシア 安定化ジルコニア層を形成することにより4種の焼成用 治具を製造した。

【0029】得られた実施例2-1~2-4の焼成用給 具について、実施例 1 と同様な加熱冷却サイクルを複数 回行い、ジルコニア層が剝離する回数を調べた。その結 果を下記表2に併記する。

[0030]

	セラミック溶 射層の種類	溶射ジルコニ アの種類	型 単 発生すでの加 動 冷却回数(図)
实施师2-1	アルミナ	CaO安定化	16
実施例2-2	スピネル	CaO安定化	12
実施界2-3	+9=7	CaO安定化	15
実施例2-4	クロミア	CaO安定化	18

【0031】前配表2から明らかなようにカルシア安定 化ジルコニア層の下地層としてセラミックス層を基材上 に形成した実施例2-1~2-4の焼成用治具では前述 した安定化ジルコニア層のみの実施例1-1~1-4に 上比べて剝離が生じる加熱冷却サイクル数を延長できると とがわかる。

【0032】 (実施例3-1~3-7) 実施例1と同様 のモリブデン基材の表面にガスプラズマ法により厚さ約 30 µmの下記表3に示す7種のCr系金属層を溶射し 20 た後、アルゴンガス雰囲気中、1400℃で3時間加熱\*

\* 処理した。つづいて、熱処理後の金属層上にガスプラズ マ法により厚さ約150μ皿のカルシア安定化ジルコニ ア層をそれぞれ形成することにより7種の焼成用治具を 製造した。

【0033】得られた実施例3-1~3-7の焼成用治 具について、実施例1と同様な加熱冷却サイクルを複数 回行い、ジルコニア層が剥離する回数を調べた。その結 果を下記表3に併記する。

[0034]

【表3】

	金属海射層 の種類	溶射ジルコニ アの種類	9弾発生すでの加 熱冷却回数 (回)
实施例3-1	Cr	C●O安定化	24
实施例3-2	Cr-Ma	CaO安定化	22
实施例3-3	Cr-Fe	C。O安定化	14
<b>实施例3-4</b>	Cr-NI	C●O安定化	18
安施第3-5	Cr-Ti	C。O安定化	22
実施例3-6	Cr-Al	CaO安定化	14
実施例3-7	Cr-Nb	CaO安定化	1 8

【0035】前記表3から明らかなようにカルシア安定 化ジルコニア層の下地層としてCr系の金属層を基材上 した安定化ジルコニア層のみの実施例1-1~1-4に 比べて剝離が生じる加熱冷却サイクル数を延長できるこ とがわかる。

【0036】(実施例4-1~4-7)実施例1と同様 のモリブデン基材の表面にガスプラズマ法により厚さ約 30 µmの下記表4 に示す7種のCr系金属層を溶射し た後、アルゴンガス雰囲気中、1400℃で3時間加熱 処理した。つづいて、触処理後の金属層上にガスブラズ

マ法により厚さ約150μ四のアルミナ層をそれぞれ溶 射し、さらにガスプラズマ法により厚さ約150 µmの に形成した実施例3-1~3-7の焼成用治具では前途 40 カルシア安定化ジルコニア層をそれぞれ形成することに より7種の焼成用治具を製造した。

【0037】得られた実施例4-1~4-7の焼成用治 具について、実施例1と同様な加熱冷却サイクルを複数 回行い、ジルコニア層が剝離する回数を調べた。その結 果を下記表4に併記する。

[0038]

【表4】

7				
	金属溶射層の延期	セラミック溶 射層の種類	溶射ジルコニ アの種類	利用発生すでの加 熱冷却回数 (回)
実施例4-1	Cr .	アルミナ	CaO安定化	35
実施例4-2	Cr-Mo	アルミナ	CaO安定化	30
実施94-3	Cr-Fe	アルミナ	C = O安定化	22
实施例4-4	Cr-Ni	アルミナ	CeO安定化	22
実施例4-5	Cr-TI	アルミナ	CBO安定化	30
实施例4-6	Cr-AI	アルミナ	CaO安定化	18
实施例4-7	Cr-Nb	アルミナ	CaO安定化	20

【0038】前配表4から明らかなようにカルシア安定 化ジルコニア層の下地層としてC r 系の金属層およびア ルミナ層を基材上にこの順序で形成した実施例4-1~ 4-7の焼成用治具では前述した安定化ジルコニア層の 20 【0041】また本発明によれば、積層セラミックコン みの実施例1-1~1-4に比べて剥離が生じる加熱冷 却サイクル数を延長できることがわかる。

#### [0040]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば積 層セラミックコンデンサのような被焼成部品をその材料 と反応を生じることなく良好に焼成でき、かつ薄肉化が 可能で、さらに再利用が可能な非酸化性雰囲気焼成用治 具を提供することができる。

デンサのような被焼成部品をその材料と反応を生じると となく良好に焼成でき、かつ薄肉化が可能で、さらに再 利用が可能で、その上耐熱衝撃性の優れた非酸化性雰囲 気焼成用治具を提供することができる。